

ORISTラボツアーのご案内

【機能性薄膜 作製・加工・評価速習コース】 (電子・機械システム研究部)

このたび、大阪産業技術研究所和泉センターをより効果的にご利用いただけるよう、電子材料・デバイス分野に特化したラボツアーを企画いたしました。

本ラボツアーでは、薄膜作製、微細加工、薄膜評価装置をご紹介します。電子デバイス研究室が保有する装置をご理解いただく大変良い機会となっておりますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。

◆日 時：平成 29 年 12 月 6 日 (水) 13 : 20 ~ 16 : 20 (受付 13 : 00 より)

(バスでお越しの場合、12 : 54 に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。)

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。(営業時間：11:45~13:15)

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野 2-7-1)

当日は、ツアー開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。開始時刻になりましたら担当者がご案内します。

◆定 員：9 名 (1 社 2 名まで)

※受講票は発行しません。返信で受付をお知らせします。

※受講には顧客登録カード(Kカード)が必要です。まだお持ちでない方は、申込み方法をご連絡いたします。

◆受 講 料：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※ お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) または FAX ([0725-51-2520](tel:0725-51-2520)) でお願います。

◆ツアー内容

1. 電子デバイス研究室の装置と利用方法について (13 : 20 ~ 13 : 45)

電子・機械システム研究部 岡本 昭夫

2. 薄膜作製、微細加工、薄膜評価装置の見学・実演 (13 : 45 ~ 16 : 00)

・薄膜作製装置 (多機能真空蒸着装置、高密度プラズマ CVD 成膜装置、スパッタ装置など)

電子・機械システム研究部 筧 芳治、近藤 裕佑

・微細加工装置 (両面マスクアライナー、ドライエッチング装置、レーザ描画装置など)

電子・機械システム研究部 佐藤 和郎、村上 修一

・薄膜評価装置 (磁気特性測定装置、触針式膜厚測定装置、薄膜用スクラッチ試験機など)

電子・機械システム研究部 山田 義春、中山 健吾

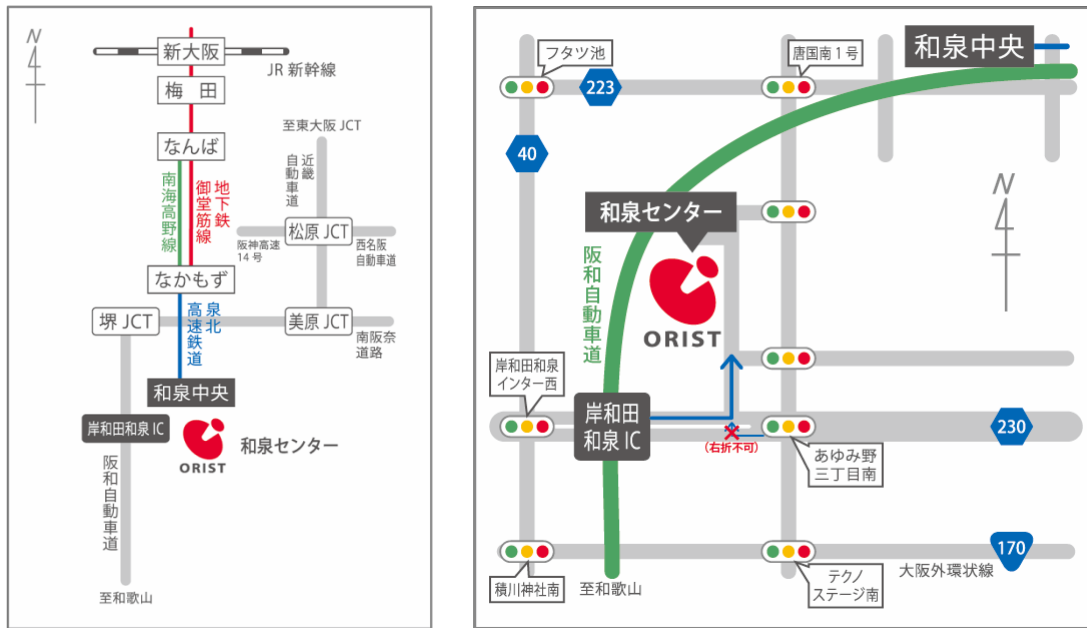
3. 質疑応答 (16 : 00 ~ 16 : 20)

※当日はクリーン服を着用しての作業がありますので、スカート等の服装はお避けください。

◆ツアー担当：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 電子・機械システム研究部 (佐藤 和郎)

◆お問い合わせ先：顧客サービス部 (TEL : 0725-51-2518)

大阪産業技術研究所 和泉センター 交通案内図 (略図)



和泉中央駅バス乗り場5番から 研究所方面へのバスが出ております 和泉中央駅発バス時刻
 9時：7, 27分
 10時：3, 34, 57分
 11時：21, 54分
 12時～15時：毎 24, 54分

駐車場は、入口から入って左手にあります。ご利用下さい。

「大阪技術研前」で下車して下さい

FAX 0725-51-2520

(地独) 大阪産業技術研究所 顧客サービス部 行
ORISTラボツアー「機能性薄膜 作製・加工・評価速習コース (電子・機械システム研究部)」
参加申込書
開催日：H29.12.6 (水)

会社名			
所在地	(〒)		
参加者	所属：	役職：	氏名： (K)
	所属：	役職：	氏名： (K)
顧客登録カード(Kカード)をお持ちの方は、「K番号」のご記入もお願いします。			
連絡先	TEL：	FAX：	
講習会の情報源	①Web ページ ②メール配信 ③チラシ ④他機関の情報 ⑤その他 ()		

※ 上記参加申込書に記載された内容につきましては、本講習会の参加者の集計及び下記の目的に使用させていただきます。
 ①お客様からの問い合わせへの対応、当研究所利用に関する手続きの案内など、お客様サポート。
 ②当研究所および関連団体の催事情報提供などの案内。

※講習会等の申込状況の確認はこちら → <http://tri-osaka.jp/c/seminar/seminar.html>
 ※講習会の案内など、当研究所の関連情報をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版」の配信を新規にご希望の方はこちら → <http://tri-osaka.jp/c/menu/mail.html>